科学研究費助成事業(科学研究費補助金)研究成果報告書

平成24年 6月 8日現在

磯関番号:82110
研究種目:基盤研究 (C)
研究期間:2009~2011
課題番号:21540414
研究課題名(和文) 安定的レーザーチャネル下での光パラメトリック過程で生じる光パル
のダイナミックス
研究課題名(英文) Dynamics of the laser filed from parametric procedure at stable lase
channeling condition
研究代表者
森 道昭(MORI MICHIAKI)
独立行政法人日本原子力研究開発機構・量子ビーム応用研究部門・研究職
研究者番号:10323271

研究成果の概要(和文): 安定的なレーザーチャネリング条件下でのダイナミックスについて 調査した。モデル計算を使った考察から、レーザー強度が真空時の強度(~9x10¹⁷ W/cm²)に比べ 20 倍近くの 2x10¹⁹ W/cm²までエンハンスされている事が分かった。

研究成果の概要(英文): We investigated the dynamics under conditions of stable laser channeling. From a consideration with the model calculation, it was found to be enhanced up to $2x10^{19}$ W/cm² near 20-fold compared to ~ $9x10^{17}$ W/cm² of the vacuum laser intensity.

交付決定額

(金額単位:円)

	直接経費	間接経費	合 計
2009 年度	1, 500, 000	450,000	1, 950, 000
2010 年度	500,000	150,000	650,000
2011 年度	600,000	180,000	780,000
年度			
年度			
総計	2,600,000	780,000	3, 380, 000

研究分野:数物系科学

科研費の分科・細目:原子・分子・量子エレクトロニクス キーワード:fs レーザー・量子ビーム・T³レーザー・プラズマ

1. 研究開始当初の背景

相対論的強度を持つレーザー電場とプラ ズマとの相互作用に関する研究は、フェムト 秒のバンチ幅を持つ準単色電子ビームや MeV 級の高エネルギーイオンビームなどの高エ ネルギー粒子発生とその最適化に興味が集 まっている。しかしレーザー駆動準単色高エ ネルギー電子発生において重要な役割を果 たす誘導ラマン散乱は、非線形光学結晶を用 いた光パラメトリック発振(OPO)や光パラメ トリック増幅(OPA)としてよく知られている 光パラメトリック過程の1つであり、これに より生成される光パルスは、特に時間波形で はポンプレーザーとは全く異なる性質を持 つ。したがって、この光の性質を十分に把握 した上でそれを利用する事ができれば、従来 光学系の損傷の問題から生成が困難だった 超高強度レーザーでの例えば 10 フェムト秒 級のパルス列や急峻な立ち上がりを持つパ ルスなどの特異な光パルスの生成が可能に なり、非線形光学結晶を用いた光パラメトリ ック発振によって得られる光と同様、新たな レーザー光源として展開できると考えられ る。

2. 研究の目的

研究代表者は、2008年にレーザー駆動フェ ムト秒電子バンチを応用した放射線化学反 応に関する研究において、通常ヘリウムガス をターゲットとしてフェムト秒電子バンチ を発生させるのに対し、高度にプレパルスを 制御した上でアルゴンガスを用いる事によ り、特定のプラズマ密度において光パラメト リック過程の1つである誘導ラマン散乱の 安定性の向上と長尺化がもたらされる事を 電子線の空間分布・安定性・エネルギースペ クトルの結果から明らかにした。このような 条件の下では10~15フェムト秒のパル ス列が発生していると推測される。しかし多 くの点が未解明であり最適化も進んでいな い。本研究ではこの安定条件のメカニズムの 解明を中心に研究を行う。

3. 研究の方法

(1) 高 Z(アルゴン)ガスにおける電子ビ ーム安定化のメカニズムの解明

高 Z ガス(アルゴンガス)による安定的な 電子ビーム生成のメカニズムを調べた。具体 的にはターゲットパラメーター(低 Z(ヘリウ ム)/高 Z (アルゴン)のガス圧)を変化させ、 安定性を含めた電子ビームのパラメーター の評価とトムソン散乱計測によるウェーク 場の診断を通じ安定化のメカニズムの解明 を行った。

(2) 電子ビーム発生の閾値の調査を通じ た相互作用の評価

照射レーザーのピーク出力に対する電子 ビーム生成の閾値のスケーリングから、相対 論的自己収束によって増強されるレーザー 強度の間接的な評価を行った。具体的には、 レーザー強度の変化に対応する、電子ビーム の発生のプラズマ密度の閾値の変化量から、 モデル計算を用いて相対論的自己収束によ って増強されるレーザー強度を推計した。

(3) 2つの高 Z ガスにおけるレーザー伝搬 の計測と光線追跡計算によるダイナミック スの評価

ガス種を変えることでレーザープラズマ 相互作用のダイナミックスが大きく変わる。 そこでネオンガスを用い、アルゴンガスと比 較する形でレーザー伝搬の計測と光線追跡 計算を通じ評価を行った。

4. 研究成果

(1) 高 Z ガスを用いた電子ビーム安定性の 評価とそのメカニズム解明(論文②,③)

実験セットアップを図1に示す。ここで照 射レーザーは、前駆パルスのピークパワー・ パルス幅は10MW/500ps、メインパルスのピー クパワー・パルス幅は 4TW/40fs で供給した。 これを軸外し放物面鏡(OAP)にて ϕ 30um (e⁻² 径) でガスターゲット上に集光した。したが ってピーク強度はそれぞれ $2x10^{12}$ W/cm²、 9x10¹⁷ W/cm²に相当する。一方、ガスターゲ ットはパルスガスジェットを通じてスケー ル長 3.5mm(半値全幅)で集光点近傍に供給し た。ここで低Z・高Zガスの違いを評価する ために、低乙ガスとしてヘリウム・高乙ガス としてアルゴンを用いた。また、ガス密度は ヘリウム・アルゴンでそれぞれ 2.2x10¹⁹ cm⁻³、 5.0x10¹⁸ cm⁻³に設定した。これは、9x10¹⁷ W/cm² のメインのピーク強度での BSI モデルから推 測される電離価数の評価から、プラズマ電子 密度に換算して双方ともほぼ 4.5x10¹⁹ cm⁻³に 相当する。これを電磁石・蛍光板・CCDカメ ラで構成するエネルギー分析器(ESM)で計測 した。この ESM は電磁石で構成しているため 印可磁場をゼロにして電子線のイメージを 計測した。



図1 実験セットアップ

まず電子ビームの放射方向の安定性を評 価した。図2に実験結果を示す。これはヘリ ウム・アルゴンそれぞれのターゲットでの電 子ビームのショット毎の位置を比較したも のである。この結果より、電子ビームの位置 安定性が4倍以上(9.8mrad(rms)→2.4mrad) 向上している事が分かった。さらにビーム発 散角においても 1/3 に抑制 (29.8±8.8mrad→ 10.8±2.4mrad)されている事も分かった。-方、電子加速の媒体となるプラズマ波のスケ ール長さをトムソン散乱計測を通じて評価 した。その結果、アルゴンターゲットはヘリ ウムターゲットに比べて3倍以上長くなる 事を観測しており、この長尺化によって安定 性の向上がもたらされていることが分かっ た。

この結果について考察した結果、前駆パル スによる光導波路の形成が関与している事 が分かった。フェムト秒テラワットレーザー 光はそれを集光させると、トンネル電離もし くは多光子電離によってプラズマが発生す る。しかし実際のレーザー装置で生成される レーザーパルスはASE (Amplified Spontaneous Emission)ペデスタルと呼ばれ るレーザー光増幅過程で副次的に生じる前 駆パルスを含んでいる。この前駆パルスは通 常ピコからナノ秒の時間スケールでメイン ピークに比べ 5~7 桁程度低い強度を持つた め、これが十分に抑制されていないと、メイ ンパルス到達前にターゲットを加熱させ、場 合によってはプラズマ化を引き起こす。

この前駆パルスにおいて支配的となる電 離過程は多光子電離とそれに続くカスケー ド電離である。この電離はレーザーパルス (プレパルス)の強度・パルス幅に依存すると ともに、高乙ガスは低乙ガスと比較して特に 低い第1電離閾値を持つため、より低いレー ザー強度で電離が生ずる。この前駆パルス (パルス幅 500ps, 強度 2x10¹² W/cm²)によるカ スケード電離の閾値はヘリウムおよびアル ゴンそれぞれ 4x10¹²W/cm² および 9x10¹¹W/cm² と見込まれる。したがって、この条件ではア ルゴンガスターゲットにおいてのみ電離が 生じていると推測される。このような電離状 態はプラズマの密度勾配をもたらし、レーザ 一光導波路を形成する。つまり、中心部で低 く周囲で高いプラズマ電子密度分布が形成 される事により、屈折率に勾配を持つグレー デッドインデックス型光ファイバーと同等 の状態が形成され、それをガイドとした光導 波路が形成される。前述のカスケード電離と プラズマの拡散によって生じるレーザー







断面方向に生じるプラズマ電子密度の窪み は、高々10%程度と見積もられる。しかし、 これは、Sprangle が提示している光導波路形 成の条件を十分に満たす。このことから、特 にアルゴンターゲットにおいて長尺のウェ ーク場の生成とそれに伴う電子ビームの安 定化が得られたものと推測される。

(2)電子ビーム発生の閾値の調査を通じ た相互作用の評価(論文①)

テラワットレーザー照射による電子線発 生において、レーザーパワーとプラズマ密度 をパラメーターとする閾値が存在する。この 関係を用いる事で相対論的自己収束による エンハンスされたレーザー強度を間接的に 評価することができる。そこで、照射レーザ ーのパワーを変化させこの評価を行った。具 体的には、(1)と同じ実験セットアップでレ ーザー出力 4TW と 3.6TW の 2 種類における 電子線発生の閾値を調べた(図4)。ターゲッ トガスはアルゴンを用いた。その結果、イン ジェクションの条件が相対論的自己収束に よって決定されることを実験結果から明ら かにするとともに、モデル計算を使った考察 から、レーザー強度が真空時の強度(~9x10¹⁷ W/cm²)から 20 倍近くの 2x10¹⁹ W/cm² にエンハ ンスされている事が分かった。



図 4 電子ビーム発生の再現性 (>1pC/>1MeV)

(3) 2つの高 Z ガスにおけるレーザー伝搬 の計測と光線追跡計算によるダイナミック スの評価

高 Z ガスが水素やヘリウムなどの低 Z ガス と大きく異なるポイントの1つは多段にわ たる微細な電離構造である。一方、ガスター ゲットは空間的に広がりを持った密度分布 を持つため、ピーク以外のフットの部分も含 めてレーザープラズマ相互作用を含めて議 論する必要がある。この研究では、ガスをア ルゴンターゲットとネオンターゲットの2 種類で比較を行い、この効果について調査し た。

実験セットアップは(1)および(2)同様の 構成で、また励起レーザーおよびターゲット の条件も(1)と同じで行った。設定した中性 ガス密度は双方とも 5x10¹⁸ cm⁻³および 6x10¹⁸ cm⁻³である。これは、9x10¹⁷ W/cm²のメインの ピーク強度から推測される電離価数から換 算して双方ともほぼ 4.5x10¹⁹ cm⁻³に相当する。

しかし、実験の結果はネオンにおいて有意 な電子線(>1pC for >1MeV)の生成は認められ なかった。そのため、中性ガス密度 5x10¹⁹ cm⁻³ までガス密度を増やす試みも行った。このこ とは、相対論効果による凸レンズ効果が増え るため、電子ビーム発生の条件の緩和に繋が るが、有意な電子ビームの発生は認めなかっ た。この現象を調べるために、横方向からの 光プローブ(パルス幅 40fs)を行いメインパ ルスの伝搬している状況を調べた。図5にア ルゴンとネオンそれぞれのレーザー伝搬の 様子を示す。この計測から、アルゴンにおい て生じていた相対論的自己収束がネオンに おいて生じていないことが分かった。



収束性の高いレーザー伝搬 収束性の低いレーザー伝搬 図 5 レーザー伝搬の比較



図6光線追跡計算の結果

この実験結果を定量的に解析するために、 相対論的自己収束による凸レンズ効果とプ ラズマによる凹レンズ効果がレーザーの伝 搬にどのような影響を与えるか光線追跡計 算による評価を行った。図6に計算結果を示 す。電離の価数の評価にはBSIモデルを用い た。その結果、ネオンターゲットではレーザ ー光が相対論効果による凸レンズ効果より もプラズマの屈折による凹レンズ効果が支

配的に影響するため、レーザー強度のエンハ ンスメントが抑制され、結果的に電子線の発 生が妨げられている事が分かった。またその 原因として、電離の構造が影響していること も分かった。図7にヘリウム・ネオン・アル ゴンそれぞれのトンネルイオン化閾値を示 す。ネオンターゲットはアルゴンターゲット と比較し、10¹⁷W/cm²を超える強度まで電離の 階層が連なっているおり、そのことが強力な 凹レンズ効果に結びついているものと推測 される。特にレーザーが集光途中のガスのフ ットの部分では、相対論的自己収束の効果が 低く、それも相まってビームの発散につなが っていると考えられる。このように高乙ガス とレーザーとの相互作用においては、このガ スのエッジ部分でのレーザープラズマ相互 作用を勘案する必要がある事がわかった。尚、 よりレーザー強度の高い実験において、ネオ ンターゲットにおいてもレーザーチャネリ ングと高エネルギー電子の生成を観測して おり、この考察の妥当性を補足する結果が得 られている。



図7 イオン化閾値の比較

5. 主な発表論文等 (研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計3件)

①<u>Michiaki Mori</u> 他, Condition of MeV electron bunch generated from Argon gas-jet target in self-modulated laser wakefield regime, Journal of Physical Society of Japan, 80 10501(2011). DOI: 10.1143/JPSJ.80.105001

②<u>森 道昭</u>,近藤公伯,High-Zガスを用いた 準単色電子ビーム特性の安定化,プラズ マ・核融合学会誌,86 147(2010).

③<u>Michiaki Mori</u>他, Generation of stable and low-divergence 10-MeV quasimonoenergetic electron bunch using argon gas jet, Physical Review Special Topics Accelerator and Beams, 12 082801(2009). DOI:10.1103/PhysRevSTAB.12.082801

〔学会発表〕(計10件)
①<u>森 道昭</u>他,SM-LWFA領域でのMeV級電
子ビーム発生におけるレーザー出力・プラズ
マ密度の条件,日本物理学会,平成24年
3月27日,関西学院大学

②<u>森 道昭</u>他, Density-ramp injection に おける Sub-MeV から 30MeV 超級への追加速, 日本物理学会,平成23年3月28日,新 潟大学

③<u>森 道昭</u>他,レーザー駆動 Sub-MeV 級準 単色電子線発生と 40MeV 級への追加速,プラ ズマ・核融合学会,平成22年12月1日, 北海道大学

 ④<u>森 道昭</u>他,3TWレーザーと気体の相互 作用によるSub-MeV級準単色電子ビーム発生, 日本物理学会,平成22年9月23日,日 本物理学会

⑤Michiaki Mori 他, STABILIZATION OF LASER ACCELERATED ELECTRON BUNCH BY THE IONIZATION-STAGE CONTROL, International Particle Accelerators Conference 2010, 2010 年 5 月 26 日 Kyoto, Japan

⑥<u>森 道昭</u>他,レーザープラズマ加速に おけるガス種最適化による高エネルギー 化・電子ビーム制御性向上,日本物理学会, 平成22年3月22日,岡山大学

⑦<u>森 道昭</u>他, J-KAREN レーザーを用いた
7MeV 級陽子線発生、レーザー学会、平成2
2年2月3日、千里ライフサイエンスセン
ター

 ⑧<u>森</u>道昭</u>他,J-KARENレーザーを用いた 高エネルギープロトン加速研究,応用物理 学会,平成21年9月11日,富山大学

⑨<u>Michiaki Mori</u>他, Studies at the Photo-Medical Research Center in Japan, Laser and Plasma Accelerators Workshop 2009,平成21年6月23日, Kardamyli, Greece

⑩<u>Michiaki Mori</u>他, Stabilization of laser accelerated electron bunch using high-Z gas-jet target in a self-injected regime, Laser and Plasma Accelerators Workshop 2009,平成21年6月23日, Kardamyli, Greece

〔図書〕(計0件)

〔産業財産権〕 〇出願状況(計1件)

名称:荷電粒子加速方法及び荷電粒子加速装 置、粒子線照射装置、医療用粒子線照射装置

発明者:森道昭,近藤公伯,神門正城,小瀧秀 行,セルゲイブラノフ,大道博行,田中和夫, 西村博明 権利者:(独)日本原子力研究開発機構 種類:特願 番号:2009-265011 出願年月日:2009年11月20日 国内外の別:国内

○取得状況(計0件)

名称: 発明者: 権類: 番号 子 月 日: 国 内 外 の別:

〔その他〕 ホームページ等

研究組織
研究代表者
森 道昭 (MORI MICHIAKI)
独立行政法人日本原子力研究開発機構・量子
ビーム応用研究部門・研究職
研究者番号:10323271